シリコンナノ粒子と中性領域の水との反応による水素発生

Hydrogen generation by the reaction of Si nanopowder with water in neutral pH region

阪大産研¹ ○(M2)藤江 俊太¹, 小林 悠輝¹, 今村 健太郎¹, 小林 光¹ISIR, Osaka Univ.¹, °Shunta Fujie¹, Yuki Kobayashi¹, Kentaro Imamura¹, Hikaru Kobayashi¹

E-mail: fujie42@sanken.osaka-u.ac.jp

【序論】水素は、活性酸素のうち最も強い酸化力を示すヒドロキシラジカル(OH・)とのみ反応して、これを消滅させる。¹体内で発生する OH・は細胞を酸化し破壊するため老化を促進し、ガンやアルツハイマーなど疾病の原因となる。本研究では体内、特に腸内での水素発生を想定した pH 8 付近における水素発生に着目し、シリコンナノ粒子(Si-NP)と水との水素発生反応²を検討した。

【実験】Si 粉末($\phi < 5 \mu\text{m}$)をビーズミル法により粉砕することで Si-NP を得た。粉砕した Si-NP の平均結晶子径は Scherrer 式から約 20 nm と見積った。作製された Si-NP は疎水性であるため、水とほとんど反応しない。そこでシリコンナノ粒子を親水性にするために表面処理を施した。作製した Si-NP を用いて 1 wt%炭酸水素ナトリウム水溶液を用い 37.0 °Cにて水素発生実験を行った。水素発生反応前後に XPS スペクトルを測定し、表面状態の解析を行った。また、平均結晶子径 10 nm の粒子についても水素発生実験を行った。

【結果と考察】Fig.1 に水素発生量と反応時間の関係を示す。Si 1 g あたり約 300 mL もの水素が 24 時間かけて発生することがわかる。この水素発生量は、Si 1 g で飽和水素水約 17 L を生成できることを示している。また、粒径を小さくすると短時間での発生量が増加することを確認した。次に、Fig.2 に水素発生前後に観測した Si-NP の XPS スペクトルを示す。表面処理によってサブオキサイド(sub-Ox)である Si⁺の量が増加したが SiO₂の量はほとんど変化していないことが判明した。これは表面処理によって、親水性になるが水素発生はほとんど起こらないことを示している。また、水との反応による水素発生反応の初期では反応時間と共に sub-Ox (Si²⁺, Si³⁺)が増加し、反応中期以降に Si⁴⁺が増加することも判明した。この結果は先に sub-Ox が形成されてから SiO₂へ酸化が進むことを示している。更に、熱重量分析、XPS スペクトル、XRD スペクトルの解析から計算された酸化膜の増加量は、消費された Si 量から計算したものと良好な一致を示した。

【参考文献】¹I. Ohsawa et al., *Nat. Med.*, 13 2007 688-694

²K. Imamura et al., *J. Nanopart Res.*, 18 2016 116-117.

Fig.1 シリコンナノ粒子と水との反応による水素発生量と時間の関係

Fig.2 水素発生反応前後に観測した XPS スペクトル